

핫플레이트 가열 및 미량 분석용 내열 맞춤형 Ptfе 실험실 비커

품목 번호: PL-CP232



소개

260°C까지 안정적인 핫플레이트 가열을 위해 설계된 고성능 맞춤형 PTFE 비커입니다. 탁월한 내화학성 및 변형 방지 특성을 갖추도록 설계된 이 30ml 실험실 용기는 까다로운 산업용 화학 처리 환경에서 고순도 미량 분석과 장기적인 내구성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
미량 금속 분해	핫플레이트에서 진한 질산 또는 불산으로 토양 또는 조직 샘플을 가열합니다.	금속 이온 용출이 없어 ppb 수준의 분석 정확도를 보장합니다.
반도체 에칭	공격적인 화학 용액을 사용하여 실리콘 웨이퍼의 소량 세정 및 에칭.	불산(HF)에 대한 내성과 극도의 순도는 웨이퍼 오염을 방지합니다.
제약 합성	제어된 온도에서 유기 용매 내 반응성 중간체의 환류 또는 가열.	비반응성 표면은 민감한 반응에 대한 촉매 간섭을 방지합니다.
석유화학 테스트	중유 샘플 내 휘발성 화합물 증발 및 산가 테스트.	높은 내열성은 고비점 유체의 안전한 처리를 가능하게 합니다.
환경 분석	산 보조 농축을 통해 ICP-MS용 수 샘플 준비.	소수성 벽은 100% 샘플 회수율과 최소한의 잔류물을 보장합니다.
배터리 연구	부식성 전기화학 환경에서 전해질 안정성 및 전극 물질 테스트.	에너지 저장 연구개발에 사용되는 리튬 염 및 공격적인 용매를 견딥니다.

속성	PL-CP232 시리즈 상세 사양
모델 식별	PL-CP232
표준 용량	30ml(요청 시 맞춤형 용량 가능)
재료 구성	100% 순수 고분자량 PTFE
내열성 (지속)	최대 200°C
최대 온도 한계	260°C (500°F)
내화학성	전 범위(pH 0-14); 모든 일반적인 실험실 산/용매에 내성
변형 저항	가열 중 휘어짐을 방지하는 고밀도 가공 베이스
바닥 프로필	최적화된 핫플레이트 접촉을 위한 초평면 가공 표면
제작 공차	정밀 CNC 가공, 공차 +/- 0.1mm
맞춤 제작 능력	치수, 벽 두께 및 형상 완전 맞춤화 가능